

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 7 月 21 日 (2005.7.21)

【公開番号】特開 2003-107453 (P2003-107453A)

【公開日】平成 15 年 4 月 9 日 (2003.4.9)

【出願番号】特願 2001-294719 (P2001-294719)

【国際特許分類第 7 版】

G 0 2 F 1/1335

G 0 2 B 5/02

G 0 2 B 5/08

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/30

H 0 1 L 21/336

H 0 1 L 29/786

【F I】

G 0 2 F 1/1335 5 2 0

G 0 2 B 5/02 B

G 0 2 B 5/08 A

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1368

G 0 9 F 9/30 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 4 9 D

H 0 1 L 29/78 6 1 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 12 月 2 日 (2004.12.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の画素を含んでなる画像表示領域を有し、各前記複数の画素が入射光を反射する反射領域、及び入射光を透過する透過領域を含んでなる電気光学装置において、

前記反射領域においては反射性を備えた金属膜が、前記透過領域においては透明電極が少なくとも形成されており、

前記反射領域及び前記透過領域の両領域においては前記金属膜及び前記透明電極の上層に配向膜が形成されているとともに、前記金属膜及び前記透明電極の下層に前記金属膜の表面を凹凸形状にする凹凸層が形成されてなることを特徴とする電気光学装置。

【請求項 2】

前記凹凸層の凸部分が、前記透過領域と反射領域との境界部分を跨ることなく位置するように配設された請求項 1 に記載の電気光学装置。

【請求項 3】

前記凹凸層が、透光性の感光性樹脂から形成されてなる請求項 1 又は 2 に記載の電気光学装置。

【請求項 4】

前記透明電極の形成領域が、前記金属膜の形成領域よりも広い請求項 1 ～ 3 のいずれか

に記載の電気光学装置。

【請求項 5】

前記透明電極と前記金属層とが、電氣的に接続されてなる請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の電気光学装置。

【請求項 6】

前記透明電極が、前記透過領域の外側で電位供給線と電氣的に接続されてなる請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の電気光学装置。

【請求項 7】

複数の画素を含んでなる画像表示領域を有し、各前記複数の画素が入射光を反射する反射領域、及び入射光を透過する透過領域を含んでなる電気光学装置の製造方法において、

基板に、凹凸層を形成する工程と、

前記凹凸層上に透明電極、及び反射性の金属膜を形成して前記透過領域及び前記反射領域を形成する工程と、

前記反射領域及び前記透過領域の両領域に配向膜を形成する工程と、

を具備してなり、

前記凹凸層が前記透過領域にも形成されることを特徴とする電気光学装置の製造方法。